(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-287156 (P2002-287156A)

				(43)公開日	平成14年10	月3日(2002.10.3)
(51) Int.Cl."		識別記号	FI			テーマコード(参考)
G02F	1/1339	505	G 0 2 F	1/1339	505	2H088
	1/13	101		1/13	101	2H089
	1/1341			1/1341		

審査請求 有 請求項の数8 OL (全 8 頁)

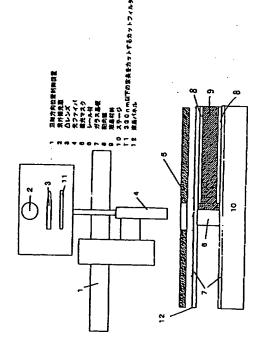
(21)出願番号	特顏2001-87931(P2001-87931)	(71)出願人	000005821 松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成13年3月26日(2001.3.26)		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者	
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者	松川 秀樹
			大阪府門真市大字門真1006番炮 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人	100076174
	· .		弁理士 宮井 暎夫
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶パネルの製造方法および製造装置

(57)【要約】

【課題】 従来、滴下工法で液晶を充填した後に液晶パ ネル12のシール材6を硬化する工程において、シール 材6を平行光とした紫外線で硬化していたが、設備が大 掛かりとなっていた。

【解決手段】 滴下工法で液晶を充填し、2枚の基板を 貼り合わせた後、シール材6の硬化を、平行光にした紫 外線をシール材6に沿って走査させて行うことにより、 設備を簡易化することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の基板のうち一方の基板にシール材 を所定の位置に形成する工程と、前記シール材を形成し た基板と他方の基板とを貼り合せる工程と、平行光とし た紫外線を前記シール材に沿って走査させ、前記シール 材を硬化する工程とを含む液晶パネルの製造方法。

【請求項2】 シール材を硬化する工程は、貼り合わせ た基板の少なくとも液晶表示部に紫外線を遮るマスクを して行うことを特徴とする請求項1記載の液晶パネルの 製造方法。

【請求項3】 シール材を硬化する工程は、紫外線の照 射角度を変更しつつ行うことを特徴とする請求項1また は2記載の液晶パネルの製造方法。

【請求項4】 配向処理を施した一対の電極付基板のう ちー方の基板にUV硬化型のシール材を、スクリーン印 刷もしくはディスペンサによる描画にて所定の位置に形 成する工程と、他方の基板に2枚の基板間のギャップを 制御するためのスペーサ材を配置する工程と、前記シー ル材を形成した基板のシール材で囲まれた領域内に所定 量の液晶材料を所定のパターンに液体吐出装置を用いて 滴下する工程と、前記液晶材料を滴下した基板と前記ス ペーサ材を配置した基板とをアライメントする工程と、 真空中で前記2枚の基板を貼り合せた後に加圧を行い、 液晶の展延とシール材の押し潰しを行い均一なギャップ を形成する工程と、貼り合せた基板のシール部分以外を マスクし、紫外線をシール材に沿って走査させてシール

材を硬化する工程とを含む液晶パネルの製造方法。

【請求項5】 紫外線を基板に照射する光源と、前記紫 外線を平行光にする凸レンズと、前記光源および前記凸 レンズを三軸方向に自在に移動させる三軸方向位置制御 手段と、前記基板を載置するステージとを備えた液晶パ ネルの製造装置。

【請求項6】 紫外線の波長領域のうち液晶材料が紫外線を吸収する波長領域の紫外線を遮光するフィルタを紫 外線照射軸線途中に備えたことを特徴とする請求項5記載の液晶パネルの製造装置。

【請求項7】 紫外線の照射角度を変更できる回動自在 のハーフミラーを紫外線照射軸線途中に備えたことを特 徴とする請求項5または6記載の液晶パネルの製造装 置、

【請求項8】 紫外線の照射角度を変更可能にした光フ ァイバを備えたことを特徴とする請求項5または6記載 の液晶パネルの製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、電子機器の表示 装置として用いることのできる液晶パネルの製造方法お よび製造装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置の製造方法には大きく2種

類ある。その一つが真空注入工法で、もう一つが滴下工 法である。前者の注入方式は、一対の配向処理された電 極付基板のうち少なくとも一方の基板に熱硬化型、紫外 線硬化型または紫外線硬化と熱硬化併用型のシール材を スクリーン印刷もしくはディスペンサを用いて所定のパ ターンとなるように形成し、他方の基板にスペーサ材を 形成しておく、これら2枚の基板を貼り合せて加圧を行 ってシール材を押し潰し、その後、シール材を紫外線ま たは加熱により硬化する。その後、必要端子部分が残る ようにガラスを割断してセルを作製し、セル内を減圧状 態のままセルに設けられた液晶注入口を液晶に接触さ せ、その後、大気加圧することによりセル内に液晶を充 填する。

【0003】この真空注入工法では、液晶をセルに充填 する時間が液晶の毛管現象を利用しているため、液晶パ ネルのサイズにより注入が完了する時間が大きく制約さ れる。従って生産ラインとして管理が非常に困難であ る。

【0004】こうした課題を解決する液晶パネルの製造 方法として滴下工法がある。この滴下工法は、一対の基 板のうちの一方の基板に形成したシール材の領域内に必 要量の液晶を機械的に滴下供給することから、パネルサ イズに関わらず液晶の充填時間を一定に制御することが 可能である。従って生産性を著しく向上することができ る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このように滴下工法で は真空注入工法に比べて液晶の充填時間が安定している ことから生産性の高いライン構築が可能である。しか し、滴下工法では基板上に形成したシール材で囲まれた 領域内に液晶を滴下したあとに、一対の基板を真空中で 貼り合せるために、未硬化のシール材と液晶材料が接す ることになる。この際、シール材を形成する成分が液晶 中に溶出するのを防ぐために、シール材の速い硬化が必 要となることから紫外線による硬化を採用している。 【0006】通常紫外線硬化型のシール材としてはアク リレートもしくはメタクリレート系を主成分とする樹脂 が使用され、この樹脂の硬化には、紫外線の波長領域が 280 nmから400 nm程度の波長で、照射エネルギ ーとしては3000mJ/cm²以上、光源の照度とし ては10mW/cm²以上が採用されている。

【0007】シール材への紫外線の照射方法としては、 シール材部分以外をマスクし、マスク上部から紫外線を 基板全体に一括照射を行っている。このとき紫外線の照 度が面内で均一となるように紫外線の散乱光を用いてい る。ここで散乱光を採用した場合、マスクの内側にも紫 外線が回り込み、表示部にも紫外線が照射されることと なる。その結果、配向膜、液晶材料、トランジスタとい った液晶パネルを構成する部材が劣化することにより表 示品位を低下することとなる。 【0008】この課題を解決するために紫外線を平行光 にすることが有効な手段であるが、紫外線を平行光にす るにはフライアイレンズを使用するなど光学系が非常に 大掛かりとなる。特に基板サイズが大きくなるに従い、 より設備的に困難となる。

【0009】また、反射型やTFTが形成された基板で は、電極部分が金属となり紫外線を完全に遮断する。そ のため平行光では電極の下に位置するシール材部分への 光の回り込みがなくシール材の十分な硬化が得られない ため、高温の環境下でシール材の未硬化成分が液晶中へ 溶出し、高湿環境下で水分が液晶へ混入するなどして、 シール材の劣化が発生し、液晶パネルの信頼性を著しく 低下させる。

【0010】これらの課題を解決するべく、本発明で は、簡易な設備で、シール材を十分に硬化することがで き、シール材の不十分な硬化による液晶パネルの信頼性 の低下を防止することのできる液晶パネルの製造方法お よびその製造装置を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】この課題を解決するべ く、請求項1記載の液晶パネルの製造方法は、一対の基 板のうち一方の基板にシール材を所定の位置に形成する 工程と、シール材を形成した基板と他方の基板とを貼り 合せる工程と、平行光とした紫外線をシール材に沿って 走査させ、シール材を硬化する工程とを含んでいる。

【0012】請求項1記載の発明によれば、平行光とし た紫外線をシール材に沿って走査させることにより、大 掛かりな従来の製造方法に比べて簡易な設備で、シール 材を十分に硬化することができ、シール材の不十分な硬 化による液晶パネルの信頼性の低下を防止することがで きる。また、簡易な設備であるため、省スペース化も図 れる。

【0013】請求項2記載の液晶パネルの製造方法は、 請求項1記載の発明において、シール材を硬化する工程 は、貼り合わせた基板の少なくとも液晶表示部をマスク して行うことを特徴とする。

【0014】請求項2記載の発明によれば、請求項1記 載の発明と同様の効果を発揮するほか、貼り合わせた基 板の少なくとも液晶表示部をマスクするため、液晶表示 部に紫外線が照射されることを防止できる。

【0015】請求項3記載の液晶パネルの製造方法は、

請求項1または2記載の発明において、シール材を硬化 する工程は、紫外線の照射角度を変更しつつ行うことを 特徴とする。

【0016】請求項3記載の発明によれば、請求項1ま たは2記載の発明と同様の効果を発揮するほか、紫外線 の照射角度を変更することにより、反射型液晶パネルや TFTを形成した液晶パネル等に設けられている金属製 電極の下に位置するシール材にも紫外線を照射すること ができ、その結果、平行光とした紫外線を用いても金属 製電極の下に位置するシール材を十分に硬化することが できる。したがって、シール材の不十分な硬化による液 晶パネルの信頼性の低下を防止することができる。

【0017】請求項4記載の液晶パネルの製造方法は、 配向処理を施した一対の電極付基板のうち一方の基板に UV硬化型のシール材を、スクリーン印刷もしくはディ スペンサによる描画にて所定の位置に形成する工程と、 他方の基板に2枚の基板間のギャップを制御するための スペーサ材を配置する工程と、シール材を形成した基板 のシール材で囲まれた領域内に所定量の液晶材料を所定 のパターンに液体吐出装置を用いて滴下する工程と、液 晶材料を滴下した基板とスペーサ材を配置した基板とを アライメントする工程と、真空中で2枚の基板を貼り合 せた後に加圧を行い、液晶の展延とシール材の押し潰し を行い均一なギャップを形成する工程と、貼り合せた基 板のシール部分以外をマスクし、紫外線をシール材に沿 って走査させてシール材を硬化する工程とを含んでい る。

【0018】請求項4記載の発明によれば、平行光とし た紫外線をシール材に沿って走査させることにより、大 掛かりな従来の製造方法に比べて簡易な設備で、シール 材を十分に硬化することができ、シール材の不十分な硬 化による液晶パネルの信頼性の低下を防止することがで きる。

【0019】請求項5記載の液晶パネルの製造装置は、 紫外線を基板に照射する光源と、その紫外線を平行光に する凸レンズと、これら光源および凸レンズを三軸方向 に自在に移動させる三軸方向位置制御手段と、基板を載 置するステージとを備えている。

【0020】請求項5記載の発明によれば、光源および 凸レンズを三軸方向に自在に移動させる三軸方向位置制 御手段を備えたことにより、平行光とした紫外線をシー ル材に沿って走査させることができ、大掛かりな従来の 製造方法に比べて簡易な設備で、シール材を十分に硬化 することができる。その結果、シール材の不十分な硬化 による液晶パネルの信頼性の低下を防止することができ る液晶パネルの製造装置を提供できる。また、簡易な設 備であるため、省スペース化を図ることのできる液晶パ ネルの製造装置を提供できる。

【0021】請求項6記載の液晶パネルの製造装置は、 請求項5記載の発明において、紫外線の波長領域のうち 液晶材料が紫外線を吸収する波長領域の紫外線を遮光す るフィルタを紫外線照射軸線途中に備えたことを特徴と する。

【0022】請求項6記載の発明によれば、請求項5記 載の発明と同様の効果を発揮するほか、液晶材料が紫外 線を吸収する波長領域を遮光するフィルタを備えたこと により、紫外線が液晶材料に照射された場合でも、液晶 材料の光劣化を防ぐことができる液晶パネルの製造装置 を提供できる。 【0023】請求項7記載の液晶パネルの製造装置は、 請求項5または6記載の発明において、紫外線の照射角 度を変更できる回動自在のハーフミラーを紫外線照射軸 線途中に備えたことを特徴とする。

【0024】請求項7記載の発明によれば、請求項5ま たは6記載の発明と同様の効果を発揮するほか、紫外線 の照射角度を変更できる回動自在のハーフミラーを備え たことにより、金属製電極の下に位置するシール材にも 紫外線を照射することができ、その結果、金属製電極の 下に位置するシール材を硬化することができる。したが って、シール材の不十分な硬化による液晶パネルの信頼 性の低下を防止することができる液晶パネルの製造装置 を提供できる。

【0025】請求項8記載の液晶パネルの製造装置は、 請求項5または6記載の発明において、紫外線の照射角 度を変更可能にした光ファイバを備えたことを特徴とす る。

【0026】請求項8記載の発明によれば、請求項5ま たは6記載の発明と同様の効果を発揮するほか、紫外線 の照射角度を変更可能にした光ファイバを備えたことに より、金属製電極の下に位置するシール材にも紫外線を 照射することができ、その結果、金属製電極の下に位置 するシール材を硬化することができる。したがって、シ ール材の不十分な硬化による液晶パネルの信頼性の低下 を防止することができる液晶パネルの製造装置を提供で きる。

[0027]

【発明の実施の形態】(第1の実施の形態)本発明の第 1の実施の形態に関して図面を用いて説明する。図1 は、本発明の第1の実施の形態を示す紫外線照射工程の 概略図である。2は紫外線を出射する光源、3は紫外線 を平行光にする凸レンズ、11は液晶が吸収する紫外線 の波長領域(一般に330 nm以下)を吸収するカット フィルタ、4は平行光となった紫外線を被射体に照射す るための光ファイバ、1はこれら光源2,凸レンズ3, 光ファイバ4,カットフィルタ11を三軸方向に自在に 移動する三軸方向位置制御装置、5は紫外線を遮る遮光 マスク、6は液晶をシールするシール材、7はガラス基 板、8は配向膜、9は液晶、12はこれらシール材6, ガラス基板7,配向膜8,液晶9からなる液晶パネル, 10は液晶パネル12を載置するステージである。

【0028】液晶パネル12の作製は、例えば、配向処 理を施した一対の基板のうち、一方の基板にUV硬化型 のシール材6をスクリーン印刷もしくはディスペンサに よる描画にて所定の位置に形成し、他方の基板にスペー サ材を配置する。一方の基板のシール材6で囲まれた領 域内に液晶材料9を滴下して、この基板とスペーサ材を 配置した基板とを貼り合わせ、加圧する。このあと、ス テージ10上に液晶パネル12を載置し、以下に述べる 紫外線照射工程を行う。 【0029】光源2、凸レンズ3および光ファイバ4を 固定した三軸方向位置制御装置(例えばXYZ稼動ロボ ット)1をシール材6のパターンに沿って動作させる。 すなわち光ファイバ4の出射部分を移動し、遮光マスク 5を介して液晶パネルのシール材6に垂直に紫外線を照 射する。なお、シール材6に照射される紫外線のスポッ ト径は、シール材6から表示領域までの距離以下が望ま しく、通常φ2mm以下である。

【0030】このとき光ファイバ4の径はφ30mm で、通常、光源2の照度として10mW/cm²以上が 採用されているが、本実施の形態では、光ファイバ4か ら出射された光の照度は100mW/cm²のものを採 用した。なお光源2は高圧水銀ランプである。このラン プの波長は液晶が吸収する波長領域である330nm以 下の領域にも強いピークを持つため、凸レンズ3の前に 330nm以下の波長領域をカットするカットフィルタ 11を挿入した。また、紫外線硬化型のシール材6とし てアクリレート系もしくはメタクリレート系の樹脂を使 用できるが、本実施の形態で使用したシール材6はアク リレート系樹脂で、硬化に必要なエネルギーは3000 mJ/cm²である。従って光ファイバ4の移動速度は 1mm/秒とした。

【0031】この紫外線照射装置と照射条件のもとで、 液晶を滴下し2枚の基板を貼り合せて作製した液晶パネ ル12のシール材6を硬化した。今回作成した液晶パネ ル12は単純マトリクス型の液晶パネルであり、一対の ポリイミド系の配向膜8を形成したガラス基板7とネマ チック液晶材料9とシール材6,透明電極(図示せず) から形成されており、シール材6の線幅は1±0.2m mのものである。なお、シール材6部分にも透明電極 (図示せず)が形成されているが、この透明電極は紫外 線を透過するので透明電極下方のシール材6にも紫外線 は照射される。

【0032】このとき遮光マスク5のシール材6部分の 抜き幅は2mmとした。したがって紫外線は液晶材料に 0.4~0.5mmの領域で照射される。しかしカット フィルタ11の効果により液晶の劣化は認められない。 またシール材6のエッジから表示画素までの距離が1m mであることから現条件では表示部分への影響もない。 従って表示品位の良好な液晶パネルを提供できる。

【0033】(第2の実施の形態)次に本発明の第2の 実施の形態に関して図面を用いて説明する。図2は、本 発明の第2の実施の形態を示す紫外線照射工程の概略図 である。1から12までは第1の実施の形態と同じであ る。21は紫外線照射角度を変更可能にするハーフミラ ーである。

【0034】第1の実施の形態と同様にして作製した液 晶パネル12をステージ10に載置し、以下に述べる紫 外線照射工程を行う。

【0035】三軸方向位置制御装置(例えばXYZ稼動

ロボット)1に光源2から出射した紫外線を凸レンズ3 を通して平行光にし、その光を被写体部分に照射するた めの光ファイバ4を固定し、遮光マスク5と光ファイバ 出射部分との中間にハーフミラー21を挿入し、光ファ イバ4からの垂直な光とハーフミラー21で反射した光 とを遮光マスク5を介して液晶パネル12のシール材6 に照射する。そしてシール材6のパターンに沿ってXY Z稼働ロボット1が動作し、光ファイバ4の出射部分が 走査する。なお、シール材6に照射される紫外線のスポ ット径は、シール材6から表示領域までの距離以下が望 ましく、通常φ2mm以下である。

【0036】このとき光ファイバ4の径はφ30mm で、通常、光源2の照度として10mW/cm²以上が 採用されているが、本実施の形態では、光ファイバ4か ら出射された光の照度は100mW/cm²のものを採 用した。なお光源2は高圧水銀ランプである。このラン プの波長は330nm以下の領域にも強いビークを持つ ため凸レンズ3の前に330nm以下の波長領域をカッ トするカットフィルタ11を挿入した。また使用したシ ール材6はアクリレート系樹脂で硬化に必要なエネルギ ーは3000mJ/cm²である。従って光ファイバ4 の移動速度は0.5mm/秒とした。

【0037】この紫外線照射装置と照射条件のもとで、 液晶を滴下し2枚の基板を貼り合せて作成した液晶パネ ル12のシール材6を硬化した。今回作成した液晶パネ ル12は一対のポリイミド系の配向膜8を形成したガラ ス基板7とネマチック液晶材料9とシール材6から形成 されており、シール材6の線幅は1±0.2mmのもの である。そしてシール材6の部分に図3に示すように、 反射型液晶パネルやTFTを形成した液晶パネルなどに 設けられている金属製電極31が配置されている。この 金属製電極31の幅は30μmであり、液晶パネル12 の一対の基板間の厚みは5μmである。従ってハーフミ ラー21の傾き角度の(図5)は光の進行方向に対し9 度とし、また、ハーフミラー21の傾き角度のは走査中 に金属製電極31の幅によって変化させる。これにより 図5に示すように金属製電極31の下方のシール材6に も紫外線が照射される。なお、図5に示すようにシール 材6に非照射部分41が発生するが、照射部で発生した ラジカルが非照射部分41にまで伝搬するため、非照射 部分41があっても硬化される。

【0038】上記条件にて作成された液晶パネル12 は、120℃の信頼性、60℃90%の高温高湿試験に て1000時間でシール周辺部分の表示品位の劣化は認 められなかった。

【0039】(第3の実施の形態)最後に本発明の第3 の実施の形態に関して図面を用いて説明する。図4は、 本発明の第3の実施の形態を示す紫外線照射工程の概略 図である。1から12までは第1の実施の形態と同じで あるが、本実施の形態おいて、光ファイバ4は照射角度 が変更自在にしてある。

【0040】第1の実施の形態と同様にして作製した液 晶パネル12をステージ10に載置し、以下に述べる紫 外線照射工程を行う。

【0041】光源2から出射した紫外線を凸レンズ3を 通して平行光にし、その光をシール材6に照射するため 光ファイバ4を通す。この光ファイバ4を所定の角度だ け傾けて固定し、光ファイバ4から出た光を遮光マスク 5を介して液晶パネル12のシール材6に照射する。そ してシール材6のパターンに沿って三軸方向位置制御装 置(例えばXYZ稼動ロボット)1が動作し、光ファイ バ4の出射部分が移動する。なお、シール材6に照射さ れる紫外線のスポット径は、シール材6から表示領域ま での距離以下が望ましく、通常φ2mm以下である。

【0042】このとき光ファイバ4の径はφ30mm で、通常、光源の照度として10mW/cm²以上が採 用されているが、本実施の形態では、光ファイバ4から 出射された光の照度は100mW/cm²のものを採用 した。なお光源2は高圧水銀ランプである。このランプ の波長は330nm以下の領域にも強いビークを持つた め凸レンズ3の前に330nm以下の波長領域をカット するカットフィルタ11を挿入した。また使用したシー ル材6はアクリレート系樹脂で硬化に必要なエネルギー は3000mJ/cm²である。従って光ファイバ4の 移動速度は0.5mm/秒とした。

【0043】この紫外線照射装置と照射条件のもとで、 液晶を滴下し2枚の基板を貼り合せて作成した液晶パネ ル12のシール材6を硬化した。今回作成した液晶パネ ル12は一対のポリイミド系の配向膜8を形成したガラ ス基板7とネマチック液晶材料9とシール材6から形成 されており、シール材6の線幅は1±0.2mmのもの である。そしてシール6の部分に図3に示すように、反 射型液晶パネルやTFTを形成した液晶パネルなどに設 けられている金属製電極31が配置されている。この電 極31の幅は30μmであり、液晶パネル12の一対の 基板間の厚みは5μmである。従って光ファイバ4の傾 き角度は基板に対して垂直方向に対し9度とし、また、 光ファイバ4の傾き角度は走査中に金属製電極31の幅 によって変化させる。これにより図5と同様、金属製電 極31のシール部分6にも紫外線が照射されることにな る。また、図5と同様、非照射部分41が発生するが、 照射部で発生したラジカルが非照射部分41にまで伝搬 するため、非照射部分41があっても硬化される。

【0044】上記条件にて作成された液晶パネル12 は、120℃の信頼性、60℃90%の高温高湿試験に て1000時間でシール周辺部分の表示品位の劣化は認 められなかった。

【0045】上記の第1~第3の実施の形態では、シー ル材6に沿って紫外線を走査するようにしているため、 図1,図2,図4に示すように紫外線をスポット照射す る簡易な紫外線照射装置で、シール材6を十分に硬化す ることができる。また、簡易な紫外線照射装置であるた め、省スペース化も図れる。さらに、第2,第3の実施 の形態では、金属製電極31の下方のシール材6も十分 に硬化することができる。

【0046】尚、上記第1~第3の実施の形態では光フ ァイバ4の径をゆ30mmとしたが、上記実施の形態の ように遮光マスク5を設置しておればこの光ファイバ4 の径は任意に変更可能である。また、光ファイバ4の径 がゆ2mm以下であれば遮光マスク5の必要性はない。 ここで、光ファイバ4の径を2mm以下にして小さなス ポット径としたり、遮光マスク5を用いることで、表示 領域の配向膜8やトランジスタ(図示せず)等の劣化も 防止することができる。また、より十分にシール材6を 硬化するために、光の走査方向を往復させるようにして もよい。また第1~第3の実施の形態において、カット フィルタ11を凸レンズ3の前に挿入したが、遮光マス ク5の上あるいは光ファイバ4と遮光マスク5の間に挿 入してもよい。

【0047】

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、平行光と した紫外線をシール材に沿って走査させることにより、 大掛かりな従来の製造方法に比べて簡易な設備で、シー ル材を十分に硬化することができ、シール材の不十分な 硬化による液晶パネルの信頼性の低下を防止することが できる。また、簡易な設備であるため、省スペース化が 図れる。

【0048】請求項2記載の発明によれば、請求項1記 載の発明と同様の効果を発揮するほか、貼り合わせた基 板の少なくとも液晶表示部をマスクするため、液晶表示 部に紫外線が照射されることを防止できる。

【0049】請求項3記載の発明によれば、請求項1ま たは2記載の発明と同様の効果を発揮するほか、紫外線 の照射角度を変更することにより、金属製電極の下に位 置するシール材にも紫外線を照射することができ、その 結果、平行光とした紫外線を用いても金属製電極の下に 位置するシール材を十分に硬化することができる。した がって、シール材の不十分な硬化による液晶パネルの信 顆性の低下を防止することができる。

【0050】請求項4記載の発明によれば、紫外線をシ ール上で走査させることにより、大掛かりな従来の製造 方法に比べて簡易に液晶パネルを製造することができ る.

【0051】請求項5記載の発明によれば、光源および 凸レンズを三軸方向に自在に移動させる三軸方向位置制 御手段を備えたことにより、簡易な設備を実現できる。 また、簡易な設備であるため、省スペース化を図ること のできる液晶パネルの製造装置を提供できる。

【0052】請求項6記載の発明によれば、請求項5記 載の発明と同様の効果を発揮するほか、液晶材料が紫外 線を吸収する波長領域を遮光するフィルタを備えたこと により、紫外線が液晶材料に照射された場合でも、液晶 材料の光劣化を防ぐことができる液晶パネルの製造装置 を提供できる。

【0053】請求項7記載の発明によれば、請求項5ま たは6記載の発明と同様の効果を発揮するほか、紫外線 の照射角度を変更できる回動自在にしたハーフミラーを 備えたことにより、金属製電極の下に位置するシール材 にも紫外線を照射することができ、その結果、金属製電 極の下に位置するシール材を硬化することができる。し たがって、シール材の不十分な硬化による液晶パネルの 信頼性の低下を防止することができる液晶パネルの製造 装置を提供できる。

【0054】請求項8記載の発明によれば、請求項5ま たは6記載の発明と同様の効果を発揮するほか、紫外線 の照射角度を変更可能にした光ファイバを備えたことに より、金属製電極の下に位置するシール材にも紫外線を 照射することができ、その結果、金属製電極の下に位置 するシール材を硬化することができる。したがって、シ ール材の不十分な硬化による液晶パネルの信頼性の低下 を防止することができる液晶パネルの製造装置を提供で きる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態におけるシール材の 紫外線硬化を示す概略図

【図2】本発明の第2の実施の形態におけるシール材の 紫外線硬化を示す概略図

【図3】 金属製の電極を有する液晶パネルの上面図

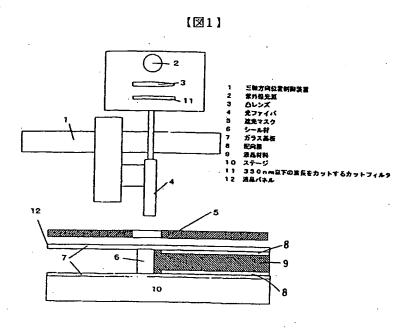
【図4】本発明の第3の実施の形態におけるシール材の 紫外線硬化を示す概略図

【図5】本発明の第2の実施の形態における非照射部分 を示す概略図

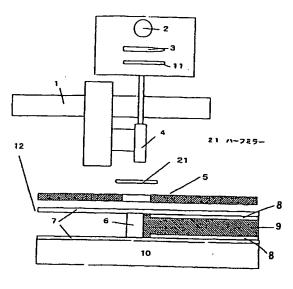
- 【符号の説明】
- 1 三軸方向位置制御装置
- 2 紫外線光源
- 3 凸レンズ
- 4 光ファイバ
- 5 遮光マスク
- 6 シール材
- 7 ガラス基板
- 8 配向膜
- 9 液晶材料
- 10 ステージ

タ

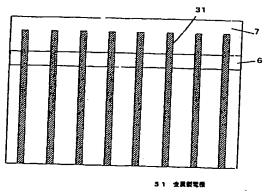
- 11 330 nm以下の波長をカットするカットフィル
- 12 液晶パネル
- 21 ハーフミラー
- 31 金属製電極
- 41 非照射部分



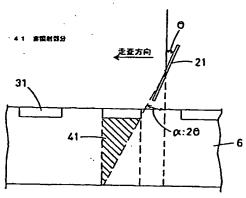
【図2】

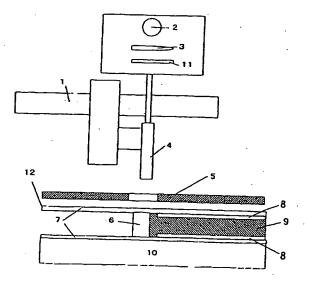


【図3】









【図4】

フロントページの続き

(72)発明者 山田 佳照 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 2H088 FA03 FA09 FA30 MA17 2H089 NA22 NA38 NA41 NA42 NA44 NA60 QA12 QA14